# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-033912

(43)Date of publication of application: 31.01.2002

(51)Int.CI.

HO4N 1/40 GO6T 1/00 GO6T 5/20 GO6T 7/60 HO4N 1/387 HO4N 7/18

(21)Application number: 2000-216279 (71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

17.07.2000

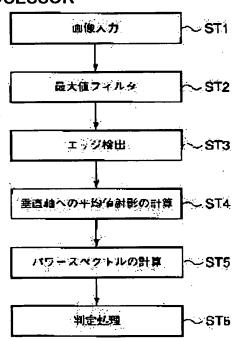
(72)Inventor: TAKIZAWA KEI

## (54) IMAGE-PROCESSING METHOD AND IMAGE PROCESSOR

### (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an image—processing method and an image processor, capable of detecting a watermark pattern which is hardly affected by illumination nonuniformity or sheet thickness nonuniformity or by any print pattern, such as a printed character or pattern.

SOLUTION: The method includes the steps in which the image of a gift certificate is inputted in a step ST1, and the maximum value filter processing is applied to the inputted image in a step ST2; edge detection processing is applied to the image to which the maximum value filter processing is operated in the step ST2 in a step ST3; the mean value projection pattern to a vertical axis is generated to the image to which the edge detection processing is applied in the step ST3 in a step ST4; a power



spectral is calculated for the mean value projection pattern generated in the step ST4 in a step ST5; and the presence or absence of watermark is judged, base don the power spectra which has been calculated in the step ST4 in a step ST6.

# **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-33912 (P2002-33912A)

(43)公開日 平成14年1月31日(2002.1.31)

| (51) Int.Cl.' |      | 識別記号 |      | FΙ    |          |    | Ť        | -7]-ド(参考) |
|---------------|------|------|------|-------|----------|----|----------|-----------|
| H04N          | 1/40 |      |      | G 0 6 | 5 T 1/00 |    | 3 1 0 Z  | 5B057     |
| G06T          | 1/00 | 310  |      |       |          |    | 500B     | 5 C O 5 4 |
|               |      | 500  |      |       | 5/20     |    | Α        | 5 C O 7 6 |
|               | 5/20 | •    |      |       | 7/60     |    | 250A     | 5 C 0 7 7 |
|               | 7/60 | 250  |      |       | •        |    | 300A     | 5 L O 9 6 |
|               |      |      | 審查請求 | 未請求   | 請求項の数10  | OL | (全 10 頁) | 最終頁に続く    |

| (21) | <b>骨条</b> 簡出 |  |
|------|--------------|--|
|      |              |  |

特願2000-216279(P2000-216279)

### (22)出顧日

平成12年7月17日(2000.7.17)

(71)出顧人 000003078

株式会社東芝

東京都港区芝浦一丁目1番1号

(72)発明者 滝沢 圭

神奈川県川崎市幸区柳町70番地 株式会社

東芝柳町事業所内

(74)代理人 100058479

弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

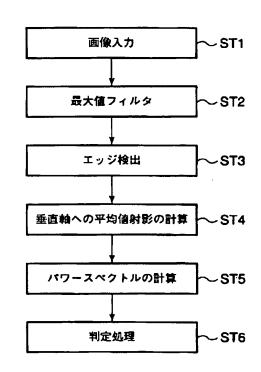
最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 画像処理方法および画像処理装置

### (57)【要約】

【課題】照明むらや用紙の厚さむら、および、印刷された文字や模様などの印刷パターンの影響を受けにくい透かしパターンなどの検知が可能となる画像処理方法および画像処理装置を提供する。

【解決手段】ステップST1にて商品券の画像を入力し、ステップST2にて入力画像に対し最大値フィルタ処理を施し、ステップST3にてステップST2で最大値フィルタ処理を施とされた画像に対しエッジ検出処理を行ない、ステップST4にてステップST3でエッジ検出処理を行なった画像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成し、ステップST5にてステップST4で生成された平均値射影パターンについてパワースペクトルを計算し、ステップST6にてステップST5で計算されたパワースペクトルに基づき透かしパターンの有無を判定する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも高い 輝度値を持つ特定パターンを有する印刷物に対し前記特 定パターンがあるか否かを検知する画像処理方法であっ て、

1

前記印刷物の画像を入力するステップと、

との入力された画像に対し画素を近傍の画素の最大値に 置き換える最大値フィルタ処理を施すステップと、

この最大値フィルタ処理を施こされた画像に対し特定パ 10 ターンとその特定パターン以外の画素との境界を強調す るエッジ検出処理を行なうステップと、

このエッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特定パ ターンの有無を判定するステップと、

を具備したことを特徴とする画像処理方法。

【請求項2】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも高い 輝度値を持つ複数の特定パターンが周期的に配置された 印刷物に対し前記特定パターンがあるか否かを検知する 画像処理方法であって、

前記印刷物の画像を入力するステップと、

この入力された画像に対し画素を近傍の画素の最大値に 置き換える最大値フィルタ処理を施すステップと、

この最大値フィルタ処理を施とされた画像に対し特定パ ターンとその特定パターン以外の画素との境界を強調す るエッジ検出処理を行なうステップと、

このエッジ検出処理を行なった画像に対し垂直軸への平 均値射影パターンを生成するステップと、

この生成された平均値射影パターンについてパワースペ クトルを計算するステップと、

との計算されたパワースペクトルにおいて、あらかじめ 判明している特定バターンの周期の周辺に極大値を持つ か否かにより前記特定パターンの有無を判定するステッ プと、

を具備したことを特徴とする画像処理方法。

【請求項3】 前記特定パターンは印刷物の用紙の厚さ の変化により描かれている透かしパターンであることを 特徴とする請求項1または請求項2記載の画像処理方 法。

【請求項4】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも低い 輝度値を持つ特定バターンを有する印刷物に対し前記特 定パターンがあるか否かを検知する画像処理方法であっ て、

前記印刷物の画像を入力するステップと、

この入力された画像に対し画素を近傍の画素の最小値に 置き換える最小値フィルタ処理を施すステップと、

この最小値フィルタ処理を施こされた画像に対し特定パ ターンとその特定パターン以外の画素との境界を強調す るエッジ検出処理を行なうステップと、

このエッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特定パ ターンの有無を判定するステップと、

を具備したことを特徴とする画像処理方法。

【請求項5】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも低い 輝度値を持つ複数の特定バターンが周期的に配置された 印刷物に対し前記特定パターンがあるか否かを検知する 画像処理方法であって、

前記印刷物の画像を入力するステップと、

との入力された画像に対し画素を近傍の画素の最小値に 置き換える最小値フィルタ処理を施すステップと、

この最小値フィルタ処理を施こされた画像に対し特定パ ターンとその特定バターン以外の画素との境界を強調す るエッジ検出処理を行なうステップと、

とのエッジ検出処理を行なった画像に対し垂直軸への平 均値射影パターンを生成するステップと、

この生成された平均値射影パターンについてパワースペ クトルを計算するステップと、

との計算されたパワースペクトルにおいて、あらかじめ 20 判明している特定バターンの周期の周辺に極大値を持つ か否かにより前記特定パターンの有無を判定するステッ プと、

を具備したことを特徴とする画像処理方法。

【請求項6】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、との印刷パターン内に背景よりも高い 輝度値を持つ特定パターンを有する印刷物に対し前記特 定パターンがあるか否かを検知する画像処理装置であっ て.

前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、

との画像入力手段により入力された画像に対し画素を近 30 傍の画素の最大値に置き換える最大値フィルタ処理を施 す最大値フィルタ処理手段と、

この最大値フィルタ処理手段により最大値フィルタ処理 を施こされた画像に対し特定バターンとその特定パター ン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理を行な うエッジ検出手段と、

このエッジ検出手段によりエッジ検出処理を行なった画 像に基づき前記特定パターンの有無を判定する判定手段 Ł.

を具備したことを特徴とする画像処理装置。

【請求項7】 印刷された文字や模様などの印刷パター ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも高い 輝度値を持つ複数の特定パターンが周期的に配置された 印刷物に対し前記特定パターンがあるか否かを検知する 画像処理装置であって、

前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、

この画像入力手段により入力された画像に対し画素を近 傍の画素の最大値に置き換える最大値フィルタ処理を施 す最大値フィルタ処理手段と、

50 この最大値フィルタ処理手段により最大値フィルタ処理

. 3

を施こされた画像に対し特定パターンとその特定パター ン以外の画索との境界を強調するエッジ検出処理を行な うエッジ検出手段と、

このエッジ検出手段によりエッジ検出処理を行なった画 像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成する平均 値射影パターン生成手段と、

との平均値射影パターン生成手段により生成された平均 値射影パターンについてパワースペクトルを計算するパ ワースペクトル計算手段と、

とのパワースペクトル計算手段により計算されたパワー 10 スペクトルにおいて、あらかじめ判明している特定パタ ーンの周期の周辺に極大値を持つか否かにより前記特定 パターンの有無を判定する判定手段と、

を具備したことを特徴とする画像処理装置。

【請求項8】 前記特定パターンは印刷物の用紙の厚さ の変化により描かれている透かしパターンであることを 特徴とする請求項6または請求項7記載の画像処理装 置。

【請求項9】 印刷された文字や模様などの印刷パター 輝度値を持つ特定パターンを有する印刷物に対し前記特 定パターンがあるか否かを検知する画像処理装置であっ て、

前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、

この画像入力手段により入力された画像に対し画素を近 傍の画素の最小値に置き換える最小値フィルタ処理を施 す最小値フィルタ処理手段と、

この最小値フィルタ処理手段により最小値フィルタ処理 を施こされた画像に対し特定パターンとその特定パター ン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理を行な 30 しパターンとは、偽造防止などのために、紙幣や小切 うエッジ検出手段と、

このエッジ検出手段によりエッジ検出処理を行なった画 像に基づき前記特定パターンの有無を判定する判定手段

を具備したことを特徴とする画像処理装置。

【請求項10】 印刷された文字や模様などの印刷バタ ーンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも低 い輝度値を持つ複数の特定バターンが周期的に配置され た印刷物に対し前記特定パターンがあるか否かを検知す る画像処理装置であって、

前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、

この画像入力手段により入力された画像に対し画素を近 傍の画索の最小値に置き換える最小値フィルタ処理を施 す最小値フィルタ処理手段と、

この最小値フィルタ処理手段により最小値フィルタ処理 を施てされた画像に対し特定パターンとその特定パター ン以外の画索との境界を強調するエッジ検出処理を行な うエッジ検出手段と、

このエッジ検出手段によりエッジ検出処理を行なった画 像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成する平均 50 は、入力グレイ画像について輝度ヒストグラムを計算

値射影パターン生成手段と、

この平均値射影パターン生成手段により生成された平均 値射影パターンについてパワースペクトルを計算するパ ワースペクトル計算手段と、

とのパワースペクトル計算手段により計算されたパワー スペクトルにおいて、あらかじめ判明している特定パタ ーンの周期の周辺に極大値を持つか否かにより前記特定 バターンの有無を判定する判定手段と、

を具備したことを特徴とする画像処理装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば、用紙の 厚さの変化により描かれている透かしパターンなどの特 定パターンを有する有価証券などの印刷物に対し上記透 かしパターンなどの特定パターンがあるか否かを検知す る画像処理方法および画像処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】まず、本発明で検知対象とする特定パタ ーンについて説明しておく。本発明では、たとえば、次 ンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも低い 20 の2つの条件を満たす特定パターンを検知対象とする。 【0003】(1)たとえば、図11に示すように、印 刷物S1上に設けられた矩形状のバターンP1であり、 複数個周期的に並んでいる。

> 【0004】(2)特定パターンに対応する画素が、周 辺の画素に比較して高い(または低い)輝度値を持つ。 【0005】本発明は、このような特定パターンが印刷 物内に存在するか否かの検知を行なう。

> 【0006】さて、上記2つの条件を満たす特定パター ンの具体例として、透かしパターンが挙げられる。透か 手、商品券などの有価証券に、用紙の厚さの変化により 描かれるパターンである。ととで、透かしパターンを含 む画像の具体例を図12に示す。

【0007】図12は、たとえば、商品券S2の画像を 示しており、印刷された文字や模様などの印刷バターン P2を有し、かつ、この印刷パターンP2内に背景より も高い輝度値を持ち周期的に並んでいる複数の矩形状の 透かしパターンP3を有している。なお、図示を省略し ているが、地肌模様も印刷されているものとする。以 40 下、このような透かしパターンの検知を具体例として説 明を行なう。

【0008】従来の透かしバターンの検知方法の代表的 なものとして、次の2つが挙げられる。

【0009】第1の従来法:2値化処理に基づく方法 第2の従来法:エッジ検出処理に基づく方法 まず、第1の従来法について述べる。第1の従来法は、 2値化、垂直軸への射影の計算、周期性の検証、の3つ のステップからなる。ステップ 1 の 2 値化では、P-T

ile法を用い、2値化の閾値を決定する。具体的に

10

し、図13に示すように、画索の輝度値の分布の明るい方からTAREA%の面積を与える輝度値THを2値化の関値として求める。入力グレイ画像について、関値THよりも値の大きな画素に「1」を、それ以外に「0」を割り当てることにより、2値画像を得る。これにより、図14に示すような透かしパターンの2値画像S3が得られる

【0010】ステップ2の垂直軸への射影の計算では、図15に示すように、ステップ1で得られた2値画像S3について、垂直軸に射影パターンを求める。y=Y0における射影パターンの値は、y=Y0を満たす2値画像の画素のうち、「1」の値を持つ画素の個数である。2値画像S3を2次元のパターンとして処理し、透かしパターンを検知しないのは、処理の高速化のためである。2値画像を垂直軸へ射影し、データ量の少ない射影パターンに変換するととにより、高速に処理を行なうことができる。

【0011】ステップ3の周期性の検証では、ステップ2で得られた射影パターンが、透かしパターンとしての周期性を持つか否かの判定を行なう。図16に示すよう20に、ステップ2で得られた射影パターンを、固定の大きさの範囲に分割する。範囲の大きさは、あらかじめ分かっている透かしパターンの垂直軸方向の周期の大きさとする。各範囲について最大値と最小値を求め、得られた最大値と最小値との差が一定値以上だった場合に、透かしパターンがあると判定する。

【0012】次に、第2の従来法について述べる。第1の従来法には、照明のむらや印刷物の厚さのむらなどに影響を受けやすいという問題がある。第1の従来法では、照明のむらや印刷物の厚さのむらなどにより、同一 30の画像の中で透かしパターンの部分の画素値の変動が大きくなり、2値画像中に透かしパターンが部分的にしか現われない場合や、透かしパターン以外の画素が2値画像中に現われる場合がある。このような場合には、垂直軸への射影パターンにおいて周期性が検出されず、透かしパターンの検出ができない可能性がある。

【0013】そこで、第2の従来法では、第1の従来法の問題点を解決するため、第1の従来法を行なう前に、エッジ検出処理を行なうものである。第2の従来法は、エッジ検出処理により、エッジの強い画素が透かしバターンとして検出されるため、透かしバターンの部分の画素値の変動に対して影響を受けにくくなる。

### [0014]

【発明が解決しようとする課題】まず、第1の従来法の問題点を述べる。第1の従来法には、照明のむらや印刷物の厚さのむらなどに影響を受けやすいという問題がある。第1の従来法では、照明のむらや印刷物の厚さむらなどにより、同一の画像の中で透かしパターンの部分の画素値の変動が大きくなり、2値画像中に透かしパターンが部分的にしか現われない場合や、透かしパターン以 50

外の画素が2値画像中に現われる場合がある。このような場合には、垂直軸への射影パターンにおいて、周期性が検出されず、透かしパターンの検知ができない可能性がある。

【0015】次に、第2の従来法の問題点について述べる。第2の従来法は、第1の従来法における照明むらや印刷物の厚さのむらなどに影響を受けやすいという問題点を解決するため、はじめにエッジ検出処理を行なう方法である。第2の従来法には、印刷物に印刷されている文字や模様などの印刷バターンが影響を受けやすいという問題がある。文字や模様などの印刷バターンは、人間が見やすいように印刷されている場合が多く、文字バターンと用紙とのコントラストや、模様と用紙とのコントラストの方が、透かしバターンと用紙とのコントラストに較して大きい場合がある。とのため、エッジ検出後の画像では、文字バターンや模様などがエッジとして大きな値を持ってしまうため、2値画像においても、これらのバターンが現れてしまい、透かしバターンの検知に悪影響を与える場合がある。

【0016】次に、第1の従来法と第2の従来法とに共通の問題点について述べる。第1の従来法および第2の従来法ともに、周期性の検証において、高周波成分に影響を受けやすいという問題がある。たとえば、図17に示すように、2値画像から得られる射影バターンが、透かしバターンの周波数よりも大きな周波数成分を含む場合、透かしバターンの周波数成分があるか否かに関わらず、透かしバターンがあると判定されてしまう。

【0017】そこで、本発明は、照明むらや用紙の厚さむら、および、印刷された文字や模様などの印刷パターンの影響を受けにくい透かしパターンなどの検知が可能となる画像処理方法および画像処理装置を提供することを目的とする。

【0018】また、本発明は、入力画像の高周波成分に対して影響を受けにくく、誤判定を防止できる画像処理方法および画像処理装置を提供することを目的とする。 【0019】

【課題を解決するための手段】本発明の画像処理方法は、印刷された文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印刷パターン内に背景よりも高い輝度値を持つ特定パターンを有する印刷物に対し前記特定パターンがあるか否かを検知する画像処理方法であって、前記印刷物の画像を入力するステップと、この入力された画像に対し画素を近傍の画素の最大値に置き換える最大値フィルタ処理を施すステップと、この最大値フィルタ処理を施された画像に対し特定パターンとその特定パターン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特定パターンの有無を判定するステップとを具備している。

【0020】また、本発明の画像処理方法は、印刷され

30

50

た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷パターン内に背景よりも高い輝度値を持つ複数の特定 バターンが周期的に配置された印刷物に対し前記特定バ ターンがあるか否かを検知する画像処理方法であって、 前記印刷物の画像を入力するステップと、この入力され た画像に対し画素を近傍の画素の最大値に置き換える最 大値フィルタ処理を施すステップと、この最大値フィル タ処理を施こされた画像に対し特定パターンとその特定 パターン以外の画索との境界を強調するエッジ検出処理 を行なうステップと、このエッジ検出処理を行なった画 10 像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成するステ ップと、この生成された平均値射影パターンについてパ ワースペクトルを計算するステップと、この計算された パワースペクトルにおいて、あらかじめ判明している特 定バターンの周期の周辺に極大値を持つか否かにより前 記特定パターンの有無を判定するステップとを具備して いる。

7

【0021】また、本発明の画像処理方法は、印刷され た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷パターン内に背景よりも低い輝度値を持つ特定パター 20 ンを有する印刷物に対し前記特定パターンがあるか否か を検知する画像処理方法であって、前記印刷物の画像を 入力するステップと、この入力された画像に対し画素を 近傍の画素の最小値に置き換える最小値フィルタ処理を 施すステップと、この最小値フィルタ処理を施こされた 画像に対し特定パターンとその特定パターン以外の画素 との境界を強調するエッジ検出処理を行なうステップ と、このエッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特 定パターンの有無を判定するステップとを具備してい る。

【0022】また、本発明の画像処理方法は、印刷され た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷バターン内に背景よりも低い輝度値を持つ複数の特定 バターンが周期的に配置された印刷物に対し前記特定バ ターンがあるか否かを検知する画像処理方法であって、 前記印刷物の画像を入力するステップと、この入力され た画像に対し画素を近傍の画素の最小値に置き換える最 小値フィルタ処理を施すステップと、この最小値フィル タ処理を施こされた画像に対し特定パターンとその特定 バターン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理 を行なうステップと、このエッジ検出処理を行なった画 像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成するステ ップと、この生成された平均値射影パターンについてパ ワースペクトルを計算するステップと、この計算された パワースペクトルにおいて、あらかじめ判明している特 定パターンの周期の周辺に極大値を持つか否かにより前 記特定パターンの有無を判定するステップとを具備して

【0023】また、本発明の画像処理装置は、印刷され た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷パターン内に背景よりも高い輝度値を持つ特定パター ンを有する印刷物に対し前記特定パターンがあるか否か を検知する画像処理装置であって、前記印刷物の画像を 入力する画像入力手段と、この画像入力手段により入力 された画像に対し画案を近傍の画案の最大値に置き換え る最大値フィルタ処理を施す最大値フィルタ処理手段 と、この最大値フィルタ処理手段により最大値フィルタ 処理を施とされた画像に対し特定パターンとその特定パ ターン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理を 行なうエッジ検出手段と、このエッジ検出手段によりエ ッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特定パターン の有無を判定する判定手段とを具備している。

【0024】また、本発明の画像処理装置は、印刷され た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷パターン内に背景よりも高い輝度値を持つ複数の特定 バターンが周期的に配置された印刷物に対し前記特定バ ターンがあるか否かを検知する画像処理装置であって、 前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、との画像 入力手段により入力された画像に対し画素を近傍の画素 の最大値に置き換える最大値フィルタ処理を施す最大値 フィルタ処理手段と、この最大値フィルタ処理手段によ り最大値フィルタ処理を施こされた画像に対し特定パタ ーンとその特定パターン以外の画素との境界を強調する エッジ検出処理を行なうエッジ検出手段と、とのエッジ 検出手段によりエッジ検出処理を行なった画像に対し垂 直軸への平均値射影パターンを生成する平均値射影パタ ーン生成手段と、この平均値射影パターン生成手段によ り生成された平均値射影パターンについてパワースペク トルを計算するパワースペクトル計算手段と、このパワ ースペクトル計算手段により計算されたパワースペクト ルにおいて、あらかじめ判明している特定パターンの周 期の周辺に極大値を持つか否かにより前記特定パターン の有無を判定する判定手段とを具備している。

【0025】また、本発明の画像処理装置は、印刷され た文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この印 刷パターン内に背景よりも低い輝度値を持つ特定パター ンを有する印刷物に対し前記特定パターンがあるか否か を検知する画像処理装置であって、前記印刷物の画像を 入力する画像入力手段と、この画像入力手段により入力 された画像に対し画素を近傍の画素の最小値に置き換え る最小値フィルタ処理を施す最小値フィルタ処理手段 と、この最小値フィルタ処理手段により最小値フィルタ 処理を施とされた画像に対し特定パターンとその特定パ ターン以外の画素との境界を強調するエッジ検出処理を 行なうエッジ検出手段と、このエッジ検出手段によりエ ッジ検出処理を行なった画像に基づき前記特定パターン の有無を判定する判定手段とを具備している。

【0026】さらに、本発明の画像処理装置は、印刷さ れた文字や模様などの印刷パターンを有し、かつ、この 印刷パターン内に背景よりも低い輝度値を持つ複数の特

定パターンが周期的に配置された印刷物に対し前記特定 バターンがあるか否かを検知する画像処理装置であっ て、前記印刷物の画像を入力する画像入力手段と、との 画像入力手段により入力された画像に対し画素を近傍の 画素の最小値に置き換える最小値フィルタ処理を施す最 小値フィルタ処理手段と、この最小値フィルタ処理手段 により最小値フィルタ処理を施こされた画像に対し特定 バターンとその特定バターン以外の画素との境界を強調 するエッジ検出処理を行なうエッジ検出手段と、このエ ッジ検出手段によりエッジ検出処理を行なった画像に対 し垂直軸への平均値射影パターンを生成する平均値射影 パターン生成手段と、この平均値射影パターン生成手段 により生成された平均値射影パターンについてパワース ベクトルを計算するパワースペクトル計算手段と、この パワースペクトル計算手段により計算されたパワースペ クトルにおいて、あらかじめ判明している特定パターン の周期の周辺に極大値を持つか否かにより前記特定パタ ーンの有無を判定する判定手段とを具備している。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい 20 て図面を参照して説明する。

【0028】図1は、本実施の形態に係る画像処理装置の構成を概略的に示すものである。図1において、画像入力手段としてのCCD形カメラ11は、図12に示したような商品券(印刷物)S2の画像を撮像して、デジタル画像データとして入力する。画像記憶手段としての画像メモリ12は、カメラ11で入力された商品券S2の画像を一時記憶する。各種処理手段としての画像処理部13は、たとえば、CPU(セントラル・プロセッシング・ユニット)を主体に構成されており、後で詳細を説明する最大値フィルタ処理、エッジ検出処理、平均値射影パターン生成処理、パワースペクトル計算処理、および、判定処理などを行なう。

【0029】次に、本発明の実施の形態に係る画像処理 について、図2および図3に示すフローチャートを参照 して説明する。

【0030】まず、ステップST1にて、図12に示したような商品券S2の画像をCCD形カメラ11により入力し、画像メモリ12に格納する。

【0031】次に、ステップST2にて、画像メモリ1 40 2内の画像に対し最大値フィルタ処理を施す。最大値フィルタ処理は、図4に示すように、入力画像の画素を近傍の画素の最大値で置き換える処理であり、透かしバターンの強調および文字や模様などの印刷バターンの除去を目的として行なう。図12の画像に対して最大値フィルタ処理を施した結果を図5に示し、図中、符号P4が透かしバターンの部分である。

【0032】次に、ステップST3にて、ステップST2で最大値フィルタ処理を施とされた画像に対しエッジ検出処理を行なう。エッジ検出処理は、透かしバターン50

と透かしバターン以外の画案との境界を強調するために行なう。図5の画像に対してエッジ検出処理を行なった結果を図6に示し、図中、符号P5が透かしバターンの部分である。

【0033】次に、ステップST4にて、ステップST3でエッジ検出処理を行なった画像に対し垂直軸への平均値射影パターンを生成する。平均値射影パターンの生成は、図7に示すように、各ラインについて画素の輝度値の平均を求め、垂直軸に射影した値である。図7の画像から得られる平均値射影パターンは、図8に示すようになる。

【0034】次に、ステップST5にて、ステップST4で生成された平均値射影パターンについてパワースペクトルを計算する。パワースペクトルの計算は、射影により得られた波形の周期性を検証するために行なう。とこで、平均値射影パターンf(y)(y=0,…,M-1)のパワースペクトルをP(T)(T<0)とする。Tは周期を表わす。以下、本発明で用いるパワースペクトルP(T)を定義する。

【0035】パワースペクトルP(T)は、周期Tの波 形W(T, y)とf(y)との内積のノルムであり、下 記数1のように定義する。

[0036]

【数1】

$$P^{2}(T) = \sum_{Y=0}^{M-1} |f(y)W(T, y)|^{2}$$

【0037】周期Tの波形W(T,y)は、周期Tの指数関数E(y,T)により次のように表わされる関数である。

【0038】W(T, y) = A×E(y, T) + B とこで、A, Bは定数とする。定数A, Bは、周期Tの 波形W(T, y)が下記数2(条件1)および数3(条件2)を満たすように定める。

[0039]

【数2】

条件 1 
$$\sum_{y=0}^{M-1} |w(T, y)|^2 = 1$$

[0040]

【数3】

条件2 
$$\sum_{y=0}^{M-1} W(T, y) = 0$$

【0041】上記条件1、条件2は、それぞれ周期Tの 彼形W(T,y)が正規化、正準化されていることに相当する。

【0042】また、周期Tの指数関数E(y,T)は、 下記数4のように表わされるものとする。

[0043]

【数4】

$$E(y, T) = \exp(-j\frac{2\pi y}{T})$$
 (y = 0, ..., M - 1)

11

CCで、jは、虚数単位とする。

【0044】図8の平均値射影パターンから得られるパ ワースペクトルを図りに示す。図りのパワースペクトル では、透かしバターンの周期の周辺に極大値を持つ。

【0045】本発明で用いるパワースペクトルP(T) は、離散フーリエパワースペクトルPDFT (T)を拡張 したものである。離散フーリエパワースペクトルは、 T = M/(M-1), M/(M-2), ..., M/2, M で定義される。これに対し、パワースペクトルP(T) は、0≤T≤Mを満たす任意の実数のTに対して定義さ れるため、より詳細な周波数の解析が可能である。

【0046】次に、ステップST6にて、ステップST 5で計算されたパワースペクトルP(T)に基づき透か しバターンの有無を判定する。この判定処理では、図1 Oに示すように、計算されたパワースペクトルP(T) から、あらかじめ判明している透かしパターンの周期の 範囲について、最大値を求める。 ここで、最大値を与え 20 る周期をTmax とし、透かしパターンの標準的な周期T std との差を求め、所定の閾値Thdiff と比較する。そ の結果、 | Tmax - Tstd | < Thdiff である場合、透 かしパターンがあると判定し、そうでない場合は透かし バターンがないと判定する。

【0047】以上説明したように、上記実施の形態によ れば、入力された画像に対し画素を近傍の画素の最大値 に置き換える最大値フィルタ処理を施し、この最大値フ ィルタ処理を施とした画像に対し透かしパターンとその 透かしパターン以外の画素との境界を強調するエッジ検 30 出処理を行ない、このエッジ検出処理を行なった画像に 基づき透かしパターンの有無を判定することにより、照 明のむら、および、用紙の厚さのむらの影響を受けにく い透かしパターンの検知が可能になるとともに、文字パ ターンや模様に影響を受けにくい透かしパターンの検知 が可能になる。

【0048】さらに、複数の透かしパターンが周期的に 設けられている場合、透かしパターンの周期性の判定に パワースペクトルを用いることにより、入力画像の髙周 波成分に対して影響を受けにくい透かしパターンの検知 40 が可能になる。

【0049】なお、前記実施の形態では、背景よりも高 い輝度値を持ち周期的に並んでいる複数の矩形状の透か しパターンの有無を検知する場合について説明したが、 これに限らず、たとえば、単一の透かしパターンであっ てもよく、その場合、周期性の判定は不要となる。ま た、透かしパターンの形状も矩形に限らず、たとえば、 円状や楕円状であってもよい。

【0050】さらに、前記実施の形態では、背景よりも 高い輝度値を持つ透かしパターンなどの特定パターンの 50 【符号の説明】

有無を検知する場合について説明したが、本発明はこれ に限定されるものではなく、逆に、背景よりも低い輝度 値を持つ特定パターンの有無を検知する場合にも同様に 適用できる。その場合、図2のステップST2での最大 値フィルタ処理を、入力画像の画案を近傍の画案の最小 値で置き換える最小値フィルタ処理とすればよく、その 他は前記実施の形態の場合と同様である。

[0051]

【発明の効果】以上詳述したように本発明によれば、照 10 明むらや用紙の厚さむら、および、印刷された文字や模 様などの印刷パターンの影響を受けにくい透かしパター ンなどの検知が可能となる画像処理方法および画像処理 装置を提供できる。

【0052】また、本発明によれば、入力画像の高周波 成分に対して影響を受けにくく、誤判定を防止できる画 像処理方法および画像処理装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の構成 を概略的に示すブロック図。

【図2】本発明の実施の形態に係る画像処理の流れを説 明するフローチャート。

【図3】図2のフローチャートを更に詳細に示すフロー

【図4】最大値フィルタ処理を説明するための図。

【図5】最大値フィルタ処理を施した後の画像の一例を 示す図。

【図6】エッジ検出処理を行なった後の画像の一例を示

【図7】平均値射影パターンの生成処理を説明するため の図。

【図8】生成された平均値射影パターンの一例を示す

【図9】計算されたパワースペクトルの一例を示す図。

【図10】パワースペクトルからの透かしパターンの周 期性の判定を説明するための図。

【図11】本発明で検知対象とする特定パターンの一例 を示す図。

【図12】透かしパターンを含む画像の具体例として商 品券を示す図。

【図13】従来法における2値化関値の決定を説明する ための図。

【図14】従来法における透かしパターンの2値化画像 の一例を示す図。

【図15】従来法における垂直軸への射影パターンの生 成を説明するための図。

【図16】従来法における生成された射影パターンに対 する周期性の判定を説明するための図。

【図17】従来法で透かしパターンがあると誤判定され る例を説明する図。

\*

14

S 2 ……商品券 (印刷物)

P2……印刷パターン

P3……透かしパターン (特定パターン)

13

11……CCD形カメラ(画像入力手段)

12……画像メモリ(画像記憶手段)

\*13……画像処理部(最大値フィルタ処理手段、エッジ 検出手段、平均値射影

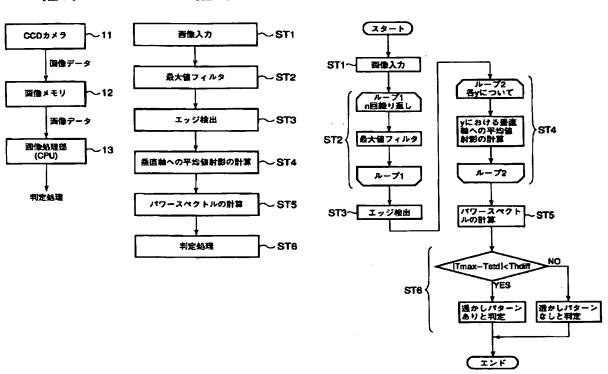
パターン生成手段、パワースペクトル計算手段、判定手

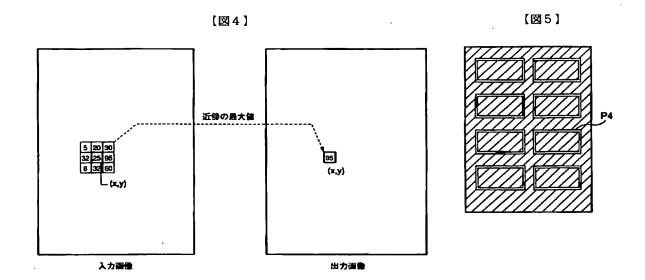
段)

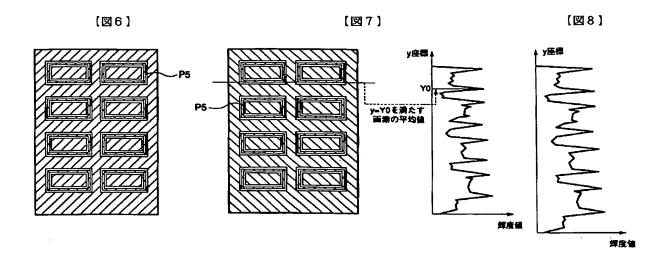
【図1】

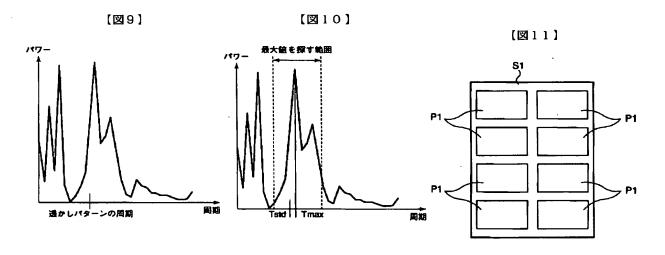
【図2】

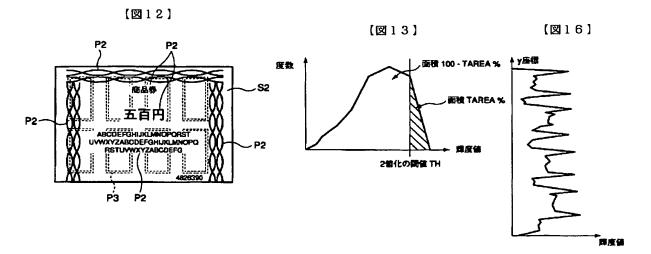
【図3】

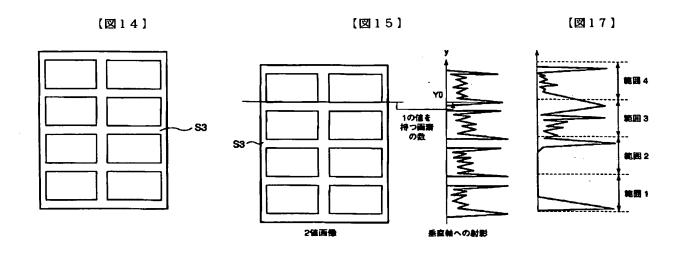












# フロントページの続き

| (51) Int.Cl.' |       | 識別記号 | FΙ      |       | ティフート'(参考) |
|---------------|-------|------|---------|-------|------------|
| G06T          | 7/60  | 300  | H 0 4 N | 1/387 |            |
| H 0 4 N       | 1/387 |      |         | 7/18  | В          |
|               | 7/18  |      |         |       | S          |
|               |       |      |         | 1/40  | Z          |

F ターム(参考) 58057 AA11 BA02 CA08 CA12 CA16 CE06 CE08 CE12 DA12 DB02 DB09 DC16 DC19 DC36 SC054 CA04 ED08 EJ04 FC04 FC14 HA05 SC076 AA14 AA31 BA06 SC077 LL14 MM03 PP03 PP23 PP43 PP46 PP49 PP55 PP65 PQ12 SL096 AA06 BA03 BA18 CA14 EA43 FA06 FA32 FA38 GA51 GA55 JA11